چهارمین همایش مشتر ک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تاثیر دمای آنیل بر خواص ساختاری و نوری پوششهای نانوساختار مزومتخلخل دی اکسید تیتانیم ایجاد شده به روش سل- ژل

بنیامین یارمند ٰو سید خطیب الاسلام صدرنژاد ٔ byarmand@merc.ac.ir

چکیدہ

پوشش های نانوساختار مزومتخلخل دی اکسید تیتانیم بر روی زیرلایه کوار تز به روش سل – ژل ایجاد شدند و تاثیر دمای آنیل بر خصوصیات ساختاری و نوری آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پراش پر تو ایکس مشخص ساخت که جوانهزنی کریستالهای فاز آناتاز در دمای ۲۰۰۵ شروع شده و با افزایش دما رشد یافته و در دمای ۲۰°۷۰ به فاز رو تیل تبدیل می شوند. اندازه کریستالیت های اولیه فازهای آناتاز و رو تیل به تر تیب بر ابر ۲/۳ و ۱۵/۳۳ است. بر رسی خصوصیات سطحی پوشش ها توسط جذب گاز نیتروژن نشان می دهد که افزایش دمای آنیل از ۴۰۰ به ۲۰۰۷ موجب کاهش مساحت سطح ویژه پوشش ها از ۱۹۳/۴۳ به ۲۹/۲۳۳² به ۲۰۰۷ موجب کاهش مساحت سطح ویژه پوشش ها از ۱۹۳/۴۳ به ۲۹/۲۳۳² شده در حالی که میانگین قطر حفرات از ۵۰/۵ به ۱۹۲۰ افزایش مشخص می سازد که با افزایش دمای آنیل میزان عبور پوشش ها در محدوده نور مرئی و فرابنفش مشخص می سازد که با افزایش دمای آنیل میزان عبور پوشش ها در محدوده نور مرئی و فرابنفش دره و می می از ۲۰۹۶ در دمای آنیل میزان عبور پوشش ها در محدوده نور مرئی و فرابنفش موجب آنها از ۲۹/۶۱۰ در دمای آنیل میزان عبور پوشش ها در محدوده نور مرئی و فرابنفش

واژههای کلیدی: پوششهای نانوساختار، مزومتخلخل، دی اکسید تیتانیم، سل-ژل.

۱- مهندسی مواد- پژوهشگاه مواد و انرژی

۲-استاد- مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی شریف

مقدمه

پوشش های نانوساختار مزومتخلخل دی اکسید تیتانیم به دلیل برخورداری از خصوصیات نوری و الکتریکی مناسب، هزینه کم تولید، سهولت روش ایجاد و پایداری شیمیایی بسیار عالی کاربرد گستردهای در ساخت انواع فتوکاتالیست ها، سنسورهای گاز، پیل های خورشیدی و باتری های قابل شارژ دارند [۱و۲]. دی اکسید تیتانیم دارای سه فاز آناتاز، روتیل و بروکایت است که هریک از آنها بسته به ماهیت خود از ویژگی های مخصوصی برخوردار بوده و حضور آنها در ترکیب پوشش بر خواص نهایی اثر می گذارد. به عنوان مثال فاز آناتاز خواص فتوکاتالیزوری مناسب تری نسبت به فاز روتیل دارد در حالی که پایداری شیمیایی و ضریب شکست نوری آن کمتر است [۳].

پوشش های دی اکسید تیتانیم توسط روش های گوناگونی نظیر تبخیر با استفاده از پرتو الکترونی [۴]، رسوب شیمیایی بخار (CVD) [۵]، رسوب دهی توسط لیزر پالسی [۶]، کندوپاش مغناطیسی [۷]، فرایندهای هیدروترمال [۸] و سل – ژل ایجاد می شوند که در بین این روش ها فرایند سل – ژل به دلیل قابلیت ایجاد پوشش همگن، کنترل و یکنواختی ترکیب شیمیایی، سهولت روش ایجاد، هزینه کم فرایند و عدم نیاز به تجهیزات پیچیده و گران قیمت اهمیت بسزایی دارد [۹].

کیفیت نهایی پوشش در فرایند سل – ژل تابع عوامل مختلفی نظیر ترکیب شیمیایی سل، نحوه پوششدهی، سرعت خروج، نحوه خشک کردن و عملیات حرارتی است که برای ایجاد پوشش مناسب باید تمامی آنها بهینه شوند. در پژوهش حاضر با توجه با اهمیت تاثیر شرایط آنیل بر خصوصیات نهایی پوشش ها در فرایند سل – ژل تاثیر دمای آنیل بر خواص ساختاری و نوری پوشش های نانوساختار مزومتخلخل دی اکسید تیتانیم مورد مطالعه قرار گرفته است.

مواد و روش تحقيق

برای ساخت سل از تترا ایزو پروپو کسید تیتانیم (TTIP) با خلوص ۹۸٪ (Merck) به عنوان آغاز گر، اسید کلریدریک با خلوص ۳۲٪ (Merck) به عنوان کاتالیزور، پلورونیک P123 (Aldrich) به عنوان تمپلت و اتانول (C₂H₅OH) با خلوص ۹۹/۹٪ (Merck) به عنوان حلال استفاده شد. ابتدا ۲/۳ اسید کلریدریک به ۵۵ تترا ایزو پروپو کسید تیتانیم اضافه گردید و در دمای اتاق به مدت ۱۰min بهم زده شد. سپس ۱۶ پلورونیک در ۲۱۶ اتانول حل شد و به محلول هیدرولیز شده فوق اضافه گردید و در دمای اتاق به مدت ۱۰min بهم زده شد. فرق اضافه گردید و به محلول هیدرولیز شده فوق اضافه گردید و در دمای اتاق به مدت ۱۰min بهم زده شد. زیرلایههای تهیه شده با ابعاد ۲۵ ۲/۰× ۲/۱× ۲/۵ پس از چربی زدایی و تمیز کاری به روش غوطه وری پوشش داده شدند. بدین ترتیب که زیرلایهها در سل تهیه شده غوطهور چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

شده و پس از گذشت چند ثانیه با سرعت ۹۰۳/min از محلول خارج شدند. پوشش های ایجاد شده به مدت ۲۴h در دمای ۲۰°۱۰ و رطوبت ۷۵–۶۵٪ نگهداری شده و سپس در کوره تونلی در مدت زمان ۱۱ در دماهای بین ۲°۹۰۰–۳۰۰ با سرعت گرمایش ۲۰mi ۲۰ در اتمسفر محیط آنیل شدند. ترکیب فازی و اندازه کریستالیت پوشش ها توسط پراش پرتو ایکس (XRD) با تابش ۵۵-۷۷ و فیلتر N۱ در ولتاژ ۲۰k۷ و شدت جریان ۳۰mA توسط دستگاه Philips, PW3710 تعیین شد. رفتار حرارتی پوشش ها توسط و شدت جریان ۳۰mA توسط دستگاه Philips, PW3710 تعیین شد. رفتار حرارتی پوشش ها توسط آنالیز حرارتی همزمان (STA) با سرعت گرمایش آرمان ۵۰ در ما ۲۰۰۰ تحت اتمسفر محیط توسط نیتروژن با استفاده از STA) با سرعت گرمایش BELSORP تا دمای ۲۰۰۰ تحت اتمسفر محیط توسط نیتروژن با استفاده از Perkin Binauer-Emmet-Teller از یابی گردید. حصوصیات نوری پوشش ها توسط طیف سنجی Philips در محدوده طول موج ۲۰۰۰۸ با سرعت

نتايج و بحث

شکل۱ طیفهای پراش پرتو ایکس نمونههای دی اکسید تیتانیم که در دماهای مختلف بین C^o-۹۰۰۰ آنیل شدهاند را نشان میدهد. ساختار پوششها قبل از آنیل به صورت آمورف است و پس از آن تبلور مییابد. در دمای C^o-۳۰۰ پیکهای فاز آناتاز ظاهر میشوند که بیانگر جوانهزنی کریستالهای آناتاز و شروع استحاله فازی آمورف به آناتاز است. با افزایش دمای آنیل از ۳۰۰ به C^o-۷۰۰ شدت پیکهای فاز آناتاز افزایش مییابد که به معنای بهبود کریستالیزاسیون این فاز است. در دمای C^o با پیکهای فاز آناتاز افزایش مییابد که به معنای بهبود کریستالیزاسیون این فاز است. در دمای C^o با بیکهای فاز آناتاز افزایش مییابد که به معنای بهبود کریستالیزاسیون این فاز است. در دمای C^o با بهبود کریستالیزاسیون این فاز است. در دمای C^o با بهبود کریستالیزاسیون این فاز است. در دمای C^o با بهبود کریستالیزاسیون این فاز است. در دمای C^o با بهبود کریستالیزاسیون این فاز است. در دمای C^o به بهبود کریستالیزاسیون این فاز است. در دمای C^o با بهبود کریستالیزاسیون این فاز است. در دمای C^o با بهبود کریستالیزاسیون این فاز است. در دمای C^o به که میابد. فاز روتیل استحاله فازی آناتاز به روتیل شروع میشود. با افزایش دمای آنیل به در دمای C^o بیکهای فاز آناتاز کاهش یافته در حالی که شدت پیکهای فاز روتیل افزایش مییابد. در دمای C^o بیکهای فاز آناتاز به طور کلی ناپدید شده و شدت پیکهای فاز روتیل افزایش یافته است. قویترین پیک مشاهده شده برای فازهای آناتاز و روتیل در دماهای مختلف آنیل به ترتیب در در دمای C^o باتی میافته است. در کهبات دیگر نظیر ناخالصیهای کربن وجود ندارد.

میانگین اندازه کریستالیت فازهای موجود در پوشش های دی اکسید تیتانیم با استفاده از اطلاعات حاصل از پراش پرتو ایکس و رابطه شرر محاسبه شد [۱۰]:

1-1

$$D = \frac{\kappa \lambda}{B\cos\theta} \tag{1}$$

در این رابطه D میانگین اندازه کریستالیتها بر حسب k ،nm عدد ثابت λ ،۰/۹ طول موج پرتو ایکس (λ =1/۵۴۰۶Å)، θ زاویه تفرق بر حسب درجه و B عرض کامل در نصف بیشینه (FWHM) پیک مورد نظر بر حسب رادیان است. کسر جرمی فاز روتیل موجود در پوشش های دی اکسید تیتانیم در غیاب فاز بروکایت توسط رابطه زیر محاسبه گردید [۱۱]:

$$X_{Rutile} = \frac{1}{1 + K(I_A / I_R)} \tag{(Y)}$$

در رابطه فوق I_A و I_R به ترتیب شدت پیکهای (۱۰۱) فاز آناتاز و (۱۱۰) فاز روتیل و K عدد ثابت۰/۷۹ است که توسط یک نمونه با مقادیر مشخص فازهای آناتاز و روتیل تعیین شده است.



شکل ۱- طیفهای پراش پرتو ایکس نمونههای دی اکسید تیتانیم آنیل شده در دماهای مختلف.

شکل۲ تغییرات میانگین اندازه کریستالیتها و مقدار فاز روتیل را در دماهای مختلف آنیل نشان میدهد. با افزایش دمای آنیل اندازه کریستالیتهای هر دو فاز افزایش یافته است. کریستالیتهای فاز آناتاز از ۳/۲ به ۲۲/۷nm با افزایش دمای آنیل از ۳۰۰ به ۲۰۰۵ و کریستالیتهای فاز روتیل از ۱۵/۳ به ۲۷/۸nm با افزایش دمای آنیل از ۲۰۰ به ۲۰۰° رشد کردهاند. مقدار فاز روتیل در دمای ۲۰۰° برابر ۱۱/۱٪ بوده و در دمای ۲۰۰۵ به ۱۰۰٪ افزایش یافته است. اندازه کریستالیت فازهای موجود در چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

پوشش های دی اکسید تیتانیم ایجاد شده در این پژوهش در مقایسه با نتایج تحقیقات دیگر بسیار کوچک تر است که به دلیل استفاده از پلورونیک به عنوان تمپلت میباشد.



شکل ۳ منحنی های آنالیز حرارتی همزمان پوشش های دی اکسید تیتانیم را نشان می دهد. در منحنی تغییرات حرارتی تفاوتی (DTA) پیک گرمازایی در دمای ۲۵°۲۵ مشاهده می شود که مربوط به احتراق و حذف ترکیب آلی از پوشش است. پیک گرمازای پهنی در محدوده دمایی ۲۵°۳۰–۳۰۰ وجود دارد که بیانگر تبلور فاز آناتاز است. دمای شروع تبلور فاز آناتاز به دلیل همپوشانی با دمای تجزیه ترکیب آلی به صورت دقیق قابل تعیین نیست. پیک گرمازای کوچکی در محدوده دمایی ۲۵°۲۰–۲۰۰ وجود دارد که بیانگر تبلور فاز روتیل است. اطلاعات حاصل از این منحنی در تطابق کامل با نتایج پراش پرتو ایکس است. مطابق منحنی تغییرات وزن (TG)، کاهش وزن در سه مرحله رخ می دهد. مرحله اول در محدوده دمایی زیر ۲۵٬۰۰ است. با توجه به اینکه هیچ پیکی در نمودار تغییرات دمایی مشاهده نمی شود می توان نتیجه گرفت که کاهش ۲/۱٪ وزن نمونه ناشی از تبخیر آبی است که به صورت فیزیکی جذب شده وزن مربوط به حذف ترکیب آلی و آب باقی مانده است. در مرحله سوم، کاهش وزن ۲/۱٪ در محدوده وزن مربوط به حذف ترکیب آلی و آب باقی مانده است. در مرحله سوم، کاهش وزن ۲/۱٪ در محدوده دمایی ک[°] ۲۰۰۲ است. الی و آب باقی مانده است. در مرحله سوم، کاهش وزن ۲/۱۰٪ در محدوده نتیجه گرفت که کاهش ۲/۱۰٪ وزن نمونه ناشی از تبخیر آبی است که به صورت فیزیکی جذب شده دمایی ک[°] ۲۰۰۶–۲۰۰ اتفاق می افتد که ناشی از حذف آب ساختاری و تبدیل هیدروکسید تیتانیم به وزن مربوط به حذف ترکیب آلی و آب باقی مانده است. در مرحله سوم، کاهش وزن ۲/۱۰٪ در محدوده دمایی ک[°] ۲۰۰۶–۲۰۰۲ اتفاق می افتد که ناشی از حذف آب ساختاری و تبدیل هیدروکسید تیتانیم به دی اکسید تیتانیم است. هیچ گونه تغییراتی در منحنی تغییرات وزن در دماهای بالاتر از ک[°] ۲۰۹۰ ایجاد



شکل ۴ منحنی های همدما جذب و دفع گاز نیتروژن و آنالیز Barrett-Joyner-Halenda (BJH) شاخه جذب نمونه های دی اکسید تیتانیم آنیل شده در دماهای مختلف را نشان می دهد. هر سه منحنی دارای جذب و دفع تدریجی بوده و از نظر شکل ظاهری شبیه منحنی نوع ۴ هستند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که پوشش های نانوساختار دی اکسید تیتانیم مزومتخلخل هستند [۱۲]. دامنه توزیع اندازه حفرات در منحنی های BJH بسیار محدود می باشد که بیانگر یکنواختی اندازه حفرات است. جدول ۱ مقادیر مساحت سطح ویژه و اندازه حفرات پوشش های دی اکسید تیتانیم که در دماهای مختلف آنیل شده از ا نشان می دهد. مشاهده می شود که افزایش دمای آنیل از ۲۰۰ به ۲۰۰۷ مساحت سطح ویژه پوشش ها را از نشان می دهد. مشاهده می شود که افزایش دمای آنیل از ۲۰۰ به ۲۰۰۷ مساحت از ۲۰۸ به ۲۰/۲۳ افزایش ای این تغییرات در خصوصیات سطحی پوشش ها ناشی از رشد دانه ها و حذف حفرات در اثر افزایش دمای آنیل است.

میانگین قطر حفرات (nm) [شاخه دفع BJH]	میانگین قطر حفرات (nm) [شاخه جذب BJH]	میانگین قطر حفرات (nm) [BET]	مساحت سطح ویژه (m ² /g)	دمای آنیل (°C)
٣/٢٨	٣/٢٨	۵/۰۵	183/43	4
۶/۱۸	۶/۱۸	٨/٢١	1•٨/٩١	۵۰۰
٧/٣٨	٨/•۶	٩/٢٠	٧٩/٢٣	٧٠٠

جدول ۱ - مساحت سطح ویژه و اندازه حفرات نمونههای دی اکسید تیتانیم.

چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران



شکل۴- الف) منحنیهای همدما جذب و دفع گاز نیتروژن و ب) منحنیهای توزیع اندازه حفرات نمونههای دی اکسید تیتانیم در دماهای مختلف آنیل.

شکل۵ طیفهای عبور نور (UV-vis) از پوششهای دی اکسید تیتانیم که در دماهای مختلف آنیل شدهاند را در محدوده طول موج ۸۰۰۳۳–۲۰۰ نشان میدهد. تمامی پوششها عبور بیش از ۸۰٪ را در محدوده نور مرئی و جذب نور در محدوده فرابنفش را از خود نشان میدهند که به گاف انرژی آنها مربوط است. با افزایش دما میزان عبور نور از پوششها در محدوده مرئی کاهش مییابد و لبه جذب آنها به سمت طول موجهای بزرگتر جابجا میشود. این تغییرات در دمای ۲۰۰۰ به علت تغییر فاز کریستالی از آناتاز به روتیل مشخصتر است. گاف انرژی پوششها با استفاده از طیفهای عبور نور و رابطه تاک محاسبه شده است [۱۳]:

$$\alpha = \frac{k(h\upsilon - E_g)^n}{h\upsilon} \tag{(7)}$$

در این رابطه ۵ ضریب جذب نور، k عدد ثابت، hv انرژی فوتون و n دارای مقادیر Λ' و ۲ به ترتیب برای انتقال مستقیم مجاز و غیر مستقیم مجاز است [۱۴]. گاف انرژی پوشش ها از برون یابی خط مماس بر ناحیه خطی نمودار $^{1/2}(\alpha hv)$ بر حسب hv تخمین زده می شود. شکل ۶ تغییرات گاف انرژی پوشش های آنیل شده در دماهای مختلف را نشان می دهد. گاف انرژی پوشش آنیل شده در دمای or ۳۰۰°C برابر ۳/۶۱eV است و به تدریج با افزایش دمای آنیل کاهش یافته و به ۳/۶۳eV در دمای O می رسد. با افزایش دما به O می می انرژی پوشش های به طور ناگهانی به ۳/۲۵eV کاهش می باد که ناشی از تبدیل فاز آناتاز به روتیل است. کاهش گاف انرژی پوشش های دی اکسید تیتانیم ناشی از

افزایش اندازه کریستالیت و چگالی پوششها با افزایش دما است. مقادیر گاف انرژی به دست آمده در این پژوهش برای پوششهای نانوساختار مزومتخلخل دی اکسید تیتانیم در مقایسه با تحقیقات دیگر بیشتر است که ناشی از اثرات کوانتومی نانو کریستالهای آن به دلیل اندازه بسیار کوچک است.



شکل۵- طیفهای عبور نور (UV-vis) از پوششهای دی اکسید تیتانیم آنیل شده در دماهای مختلف.



.h**v بر حسب (αhv**)^{1/2}

چهارمین همایش مشتر ک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

نتيجه گيري

پوشش های نانوساختار مزومتخلخل دی اکسید تیتانیم به طور موفقیت آمیز توسط روش سل – ژل ایجاد شدند و تاثیر دمای آنیل بر خواص ساختاری و نوری آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پراش پرتو ایکس نشان داد که کریستال های فاز آناتاز در دمای ۲۰۰۵ با اندازه کریستالیت ۳/۲nm شروع به جوانهزنی کرده و در دمای ۲۰۰۵ به فاز روتیل با اندازه کریستالیت ۱۵/۳nm تبدیل می شوند. مساحت سطح ویژه پوشش ها با افزایش دمای آنیل از ۴۰۰ به ۲۰۰۷ از ۱۹۳/۴۳ به ۷۹/۲۳m² کاهش می یابد در حالی که میانگین قطر حفرات از ۵/۰۵ به ۳۰۲۸۳ در دمای ۲۰۰۳ کاهش می کند. با افزایش دما آنیل گاف انرژی پوشش ها از ۲/۶۱eV در دمای ۲۰۰۳ به ۲۰۰۳ در دمای ۲۰۰۳ کاهش یافته است.

مراجع

[1] N. Venkatachalam, M. Palanichamy, V. Murugesan, Mater. Chem. Phys. 104 (2007) 454.
[2] S.Z. Chu, S. Inoue, K. Wada, D. Li, H. Haneda, S. Awatsu, J. Phys. Chem. B 107 (2003) 6586.

[3] Y.H. Hsien, C.F. Chang, Y.H. Chen, S. Cheng, Appl. Catal. B 31 (2001) 241.

[4] D. Bhattacharyya, N.K. Sahoo, S. Thakur, N.C. Das, Thin Solid Films 360 (2000) 96.

[5] K. Shalini, S. Chandrasekaran, S.A. Shivashanka, J. Cryst. Growth 284 (2005) 388.

[6] E. Gyorgy, G. Socol, E. Axente, I.N. Mihailescu, C. Ducu, S. Ciuca, Appl. Surf. Sci. 247 (2005) 429.

[7] J.C. Yu, J. Yu, L. Zhang, W. Ho, J. Photochem. Photobiol., A 148 (2002) 263.

[8] S. Kambe, K. Murakoshi, I. Kitamura, Y. Wada, S. Yanagida, H. Kominami, Y. Kera, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 61 (2000) 427.

[9] H. Yun, K. Miyazawa, I. Honma, H. Zhou, M. Kuwabara, Mat. Sci. and Eng. C 23 (2003) 487.

[10] B.D., Cullity, Elements of X-ray diffraction, Addison-Wesley Publishing Company Inc, London, 1978, p 99.

[11] R., Spurr, H., Myers, Anal Chem (1957) 29:760.

[12] N. Wark, J. Tschirch, O. Bartels, D. Bahnemann, J. Rathousky, Micropor. Mesopor. Mater. 84 (2005) 247.

[13] Sreemany, Monjoy, Sen, Suchitra, Materials Chemistry and Physics 83 (2004) 169.

[14] D. Bhattacharyya, S. Chaudhuri, A.K. Pal, Vacuum 43 (1992) 313.

Influence of annealing temperature on structural and optical properties of mesoporous TiO₂ films prepared by sol-gel technique

B. Yarmand*and S.K. Sadrnezhaad

*Corresponding Author Address: Advanced Materials Research Center, Materials and Energy Research Center, Karaj, Iran. byarmand@merc.ac.ir

Abstract

TiO₂ thin films with mesoporous structure were prepared on quartz substrate by sol gel dip coating technique. The effects of annealing temperature were examined on structural and optical properties of films. XRD-results showed that anatase phase crystallized at 300°C with crystallite size 3.2 nm and transformed to rutile phase at 700°C with crystallite size 15.8 nm. The specific surface area of film annealed at 400 °C was 163.43 m²/g and decreased to 79.23 m²/g at 900 °C. As the temperature increased, the transmittance maxima of films decreased in the visible region and the absorption edges shifted to at longer wavelength. The estimated optical band gap of films decreased from 3.61 to 3.25 eV by increasing annealing temperature from 300 to 900 C.

Keywords: Nano structure, Mesoporous, TiO₂, Sol-gel.